

超高解析場發射掃描電子顯微鏡 FE-SEM

◉ 儀器性能：

1. UHR FE-SEM 主體：超高真空、低真空、BEI 樣品表面及立體結構之觀察。
2. 鍍金(碳)機：在樣品表面鍍導電金膜、碳膜。
3. EDS 系統：分析樣品之元素。

◉ 服務項目：

1. SEM (SEI, BEI)
2. EDS 全能譜
3. EDS Mapping
4. EDS Line-scan
5. EDS 元素半定量分析
6. 鍍金 (碳)
7. 超高真空樣品表面及立體結構之觀察
8. 低真空樣品表面及立體結構之觀察



◉ 樣本準備需知：

1. 預約者者必須詳細說明試片之材料種類、製作方式與溶劑種類，減少儀器不必要的污染。
SEM 機台對於送測樣品應該具有適當、足夠的機械強度。
2. 拒絕受理之材料：
低熔點的材料如：銅、錫、鎳等。
會分解、或釋出氣體之樣品如有機物、高分子等。
具強磁性樣品或材料。
含有水份未經正確處理或充分乾燥的樣品。
粉末樣品，未預先鑲埋不接受檢測。
3. 使用者第一次預約須與管理員討論樣品處理問題。

◉ 收費標準：

1. SEM 觀察，每時段 (三小時) 8000 元
2. EDS 元素半定量分析(含定性)，每份報告 1000 元
3. EDS Mapping(含定性、半定量)，每份報告 1000 元
4. EDS Line-scan(含定性、半定量)，每份報告 1000 元
5. EDS Mapping 及 Line-scan 分析，每份報告 1500 元
6. 鍍金 (碳)，每批 600 元

◉ 儀器負責人聯絡方式：

儀器專家：林景崎教授 (03) 4227151#34328

陳一塵教授 (03) 4227151#34907

技術人員：林靜典小姐 (03) 4227151#34010、huei@cc.ncu.edu.tw

► 儀器放置地點：

中大工程五館 A 棟 1F 121-2 室